

8インチ半導体・太陽光発電基板搬送用 高精度Esd対応Peek製ウェーハ真空吸着ペン

商品番号: PL-CP115



前書き

半導体・太陽光発電分野における8インチウェーハの精密搬送向けに設計された、高性能ESD対応PEEK製ウェーハ真空吸着ペンです。カスタマイズ可能な本ソリューションは、重要なクリーンルーム環境やデリケートな基板搬送工程において、優れた耐薬品性と機械的耐久性を発揮します。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主なメリット
ウェーハ検査	光学検査またはSEM検査ステーションへの、8インチシリコンウェーハの自動搬入出。	接触面積が小さいため、表面欠陥の発生リスクを低減します。
太陽電池の選別	組立・検査工程における高効率太陽電池の搬送・選別。	ソフトな真空グリップによりマイクロクラックを防止し、セル効率を維持します。
ウェットベンチ処理	湿式化学環境における、薬液槽やリンスステーション間の基板搬送。	過酷なプロセス薬品や湿気に対して優れた耐性を発揮します。
薄膜堆積	PVD/CVD真空チャンバーまたはロードロックへの基板の出し入れ。	高温堆積サイクル後の搬送に対応できる高い熱安定性を備えています。
クリーンルーム研究開発	先端材料研究開発施設における一般的な基板搬送。	粒子放出を最小限に抑え、厳格なISO清浄度基準を維持します。
ダイボンディング前処理	ダイシングまたは後続のダイボンディング工程のためのウェーハの自動位置決め。	ESD対応特性により、敏感なマイクロ回路の潜在的な欠陥を防止します。
LED基板搬送	LEDチップ製造工程におけるサファイアまたはSiC基板の精密操作。	硬い研磨面に対しても滑りや傷をつけることなく確実にグリップします。

仕様カテゴリ	PL-CP115 仕様詳細
型番	PL-CP115 シリーズ
主要素材	高性能 ESD対応 PEEK
基板互換性	フルカスタマイズ可能 (8インチ/200mmウェーハ向けに最適化)
表面抵抗	指定されたESD安全範囲にカスタマイズ可能 (例: $10^6 - 10^9 \Omega$)
使用温度範囲	プロセス要件に基づいてカスタマイズ
薬品互換性	ユニバーサル (ほとんどの酸、塩基、溶剤に高い耐性を持つ)
真空接続タイプ	設備の真空ラインまたはポータブルポンプに合わせた特注サイジング
チップ形状	カスタム形状 (フラット、カーブ、多点) をご要望に応じて提供
クリーンルーム定格	ISOクラス3~8に対応 (用途に依存)
製造方法	特注仕様による精密CNC加工
ハンドル寸法	顧客の嗜好に合わせて人間工学的に調整